

东莞铭普光磁股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)于近日取得一项中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下:

证书号：第 4084859 号

发明名称：一种光模块参数配置方法、装置、设备及存储介质

专利号： ZL 2018 1 1603013.2

专利类型：发明专利

专利申请日：2018 年 12 月 26 日

专利权人：东莞铭普光磁股份有限公司

授权公告日：2020 年 11 月 10 日

专利权期限：20 年（自申请日起算）

本发明公开了一种光模块参数配置方法、装置、设备及存储介质，包括：将光模块放置在高温环境下，当 MCU 温度指针达到目标工作温度时，调节激光器核心温度值、偏压电流值和 VEA 值，使光模块的光功率、消光比、通道代价满足目标值；以光模块中 MCU 温度指针为索引，根据服务器上预先存储的数据库中激光器核心温度值、VEA 值与调节后的激光器核心温度值、VEA 值的对应关系，动态更新本地数据库中激光器核心温度值、VEA 值；在常温和低温下分别测试光模块的光功率、消光比和通道代价，若性能正常，则完成参数配置。本申请通过上述步骤将带 EML 激光器的光模块在高温调试和常温低温测试，即能制作成品率高和合格率高的产品。

上述发明专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于充分发挥

公司自主知识产权优势，完善知识产权保护体系，对公司开拓市场及推广产品产生积极的影响，形成持续创新机制，提升公司核心竞争力。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2020年12月9日